

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 4 月 30 日 (2009.4.30)

【公開番号】特開 2008-166830 (P2008-166830A)

【公開日】平成 20 年 7 月 17 日 (2008.7.17)

【年通号数】公開・登録公報 2008-028

【出願番号】特願 2008-11466 (P2008-11466)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 A

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 3 月 17 日 (2009.3.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ウェハを真空処理する複数のプロセス処理装置と、ウェハを収納できる複数のカセットを載置し得るカセット載置手段と、前記複数のプロセス処理装置と前記カセット載置手段との間に設けた搬送手段と、該搬送手段を用いて前記カセット載置手段上に載置される任意のカセット内からウェハを前記各プロセス処理装置に搬入し、前記各プロセス処理装置で真空処理された処理済ウェハを搬出する搬送制御を行う制御手段とで構成された真空処理装置において、

前記カセット内に収納された複数のウェハを前記搬送手段を介して共通の処理を施す複数のプロセス処理装置へ順次搬送し、搬送したウェハに共通のレシピを適用して共通の処理を施す処理、及び前記複数のカセット内に収納された複数のウェハを前記搬送手段を介してカセット毎にそれぞれ異なるプロセス処理装置へ搬送し、搬送したウェハにプロセス処理装置毎に異なるレシピを適用して異なる処理を施す処理の何れかを選択的に施すとともに処理を施した後のウェハを前記搬送手段を介してもとのカセットに戻すことを特徴とする真空処理装置。

【請求項 2】

請求項 1 記載の真空処理装置において、

前記いずれかのプロセス処理装置に装置停止の必要が生じたとき、装置停止の必要が生じたプロセス処理装置に対するカセットからのウェハの搬出を中断し、前記装置停止の必要が生じたプロセス処理装置内のウェハをもとのカセットに戻したのち装置停止の必要がないプロセス処理装置に対するカセットからのウェハの搬出を継続し処理を再開することを特徴とする真空処理装置。

【請求項 3】

カセット載置手段に載置される任意のカセット内から搬送手段を介してウェハを複数のプロセス処理装置に搬送し、該ウェハの真空処理を行う真空処理方法において、

前記カセット内に収納された複数のウェハを前記搬送手段を介して共通の処理を施す複数のプロセス処理装置へ順次搬送し、搬送したウェハに共通のレシピを適用して共通の処理を施す処理、及び前記複数のカセット内に収納された複数のウェハを前記搬送手段を介して各カセット毎にそれぞれ異なるプロセス処理装置へ搬送し、搬送したウェハにプロセス処理装置毎に異なるレシピを適用して異なる処理を施す処理の何れかを選択的に施すことと

もに処理を施した後のウェハを前記搬送手段を介してもとのカセットに戻すことを特徴とする真空処理方法。

【請求項 4】

請求項 3 記載の真空処理方法において、

前記いずれかのプロセス処理装置に装置停止の必要が生じたとき、装置停止の必要が生じたプロセス処理装置に対するカセットからのウェハの搬出を中断し、前記装置停止の必要が生じたプロセス処理装置内のウェハをもとのカセットに戻したのち装置停止の必要がないプロセス処理装置に対するカセットからのウェハの搬出を継続し処理を再開すること

を特徴とする真空処理方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

上記目的を達成するために、ウェハを真空処理する複数のプロセス処理装置と、ウェハを収納できる複数のカセットを載置し得るカセット載置手段と、前記複数のプロセス処理装置と前記カセット載置手段との間に設けた搬送手段と、該搬送手段を用いて前記カセット載置手段上に載置される任意のカセット内からウェハを前記各プロセス処理装置に搬入し、前記各プロセス処理装置で真空処理された処理済ウェハを搬出する搬送制御を行う制御手段とで構成された真空処理装置において、前記カセット内に収納された複数のウェハを前記搬送手段を介して共通の処理を施す複数のプロセス処理装置へ順次搬送し、搬送したウェハに共通のレシピを適用して共通の処理を施す処理、及び前記複数のカセット内に収納された複数のウェハを前記搬送手段を介してカセット毎にそれぞれ異なるプロセス処理装置へ搬送し、搬送したウェハにプロセス処理装置毎に異なるレシピを適用して異なる処理を施す処理の何れかを選択的に施すとともに処理を施した後のウェハを前記搬送手段を介してもとのカセットに戻すようにしたものである。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 1

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 2

【補正方法】削除

【補正の内容】